# Atomic layer stacking structure and uniaxial magnetocrystalline anisotropy for *c*-plane oriented Co films sputtered on inclined crystal plane of Ru underlayer

Shintaro Hinata<sup>1,2</sup>, Daiji Hasegawa<sup>3</sup>, Takuya Kimura<sup>2</sup>, Shin Saito<sup>2</sup>, Migaku Takahashi<sup>4</sup> and Masashi Sahashi<sup>2</sup>

 Japan Society for the Promotion of Science, Research Fellowship for Young Scientist (PD)
 Department of Electronic Engineering, Graduate School of Engineering, Tohoku University 6–6–05, Aza–Aoba, Aramaki, Aoba–ku, Sendai 980–8579, Japan 3. Waseda Institute for Advanced Study, Waseda University 1–6–1 Nishi Waseda, Shinjuku–ku, Tokyo 169–8050, Japan 4. New Industry Creation Hatchery Center (NICHe), Tohoku University 6–6–10, Aza–Aoba, Aramaki, Aoba–ku, Sendai 980–8579, Japan

Relation among structure of Ru underlayer and atomic layer stacking structure and uniaxial magnetocrystalline anisotropy ( $K_u$ ) of sputtered Co films was discussed. Small torque with amplitude below theoretical limit  $|K_u^{Cobulk}-2\pi(M_s^{Cobulk})^2| = 6.8 \times 10^6 \text{ erg/cm}^3$  was obtained for Co film with thickness  $d_{Co} < 30$  nm deposited on rough Ru underlayer. Structure analysis of the thin Co films with  $d_{Co} < 30$  nm deposited on rough Ru underlayer demonstrated that: 1) Magnitude of stacking faults were less than 1%, which meant the Co films had almost perfect hcp stacking, 2) Lattice constant c was expanded about 0.6% with retaining lattice constant a, 3) Thin Co films had rough surface which reflected morphology of the Ru underlayer. According to these results, it was thought that initial Co growth reflected vertical stacking of Ru underlayer on inclined crystal plane of the rough Ru underlayer.  $K_u$  was derived by correcting torque amplitude with self-demagnetizing energy considering surface morphology of Co film.  $K_u$ took maximal value of  $5.0 \times 10^6 \text{ erg/cm}^3$  at  $d_{Co} = 30$  nm, and rapidly decreased with decreasing  $d_{Co}$ . Reduction of  $K_u$  in  $d_{Co} < 30$  nm might be caused by decrement of crystallographic uniaxial anisotropy for Co film due to expansion of the caxis.

Key words: c-plane oriented Co film, stacking faults, uniaxial magnetocrystalline anisotropy, epitaxial growth, bumped Ruthenium

# Ru 下地層の傾斜結晶面上に成膜された c 面配向 Co スパッタ薄膜の 原子積層構造および一軸結晶磁気異方性

日向 慎太朗 <sup>1,2</sup>,長谷川 大二 <sup>3</sup>,木村 拓也 <sup>2</sup>,斉藤 伸 <sup>2</sup>,高橋 研 <sup>4</sup>,佐橋 政司 <sup>2</sup>
1.日本学術振興会 特別研究員 (PD)
2.東北大学大学院工学研究科電子工学専攻,仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-05 (〒980-8579)
3.早稲田大学高等研究所,新宿区西早稲田 1-6-1 (〒169-8050)
4.東北大学未来科学技術共同研究センター,仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10 (〒980-8579)

# 1. はじめに

Co 基合金薄膜の一軸結晶磁気異方性エネルギー(Ku) は、古くから、格子定数比 c/a や結晶粒中の積層欠陥 (Stacking Faults: SFs) の形成度合いに相関することが指 摘されている 1-3). これは、Co 基合金薄膜の Ku がスピン 軌道相互作用 (ALS) に起因するためと理解されており, cla の変化,および六方晶 (hcp) 固有の原子積層 (-A-B-A-B-...) 中への局所的な面心立方晶 (fcc, -A-B-C-原子積層)の形成度合いにより結晶の等方性が 増減し,λLが変化することに起因すると考えられている4). 我々は過去に、スパッタ法で作製した c 面配向 Co-M (M: Cr, Mo, W) 合金薄膜中に形成される SFs を実験室規模の In-plane X 線回折 (XRD) により定量評価し、SFs と Ku との相関について評価した. その結果, Ru下地上に室温で 純 Co 薄膜を作製すると hcp 原子積層中に約 10%の確率で fcc 原子積層が導入され, Ku がバルク値の半分程度にまで 低下してしまうことを明らかとした5-7). そのためスパッタ Co 薄膜の完全 hcp 原子積層化は,その手法と共に非常に興 味深い. 一般にスパッタ法による Co 薄膜の成長過程は, 1) 飛来した Co 原子がマイグレーションにより基板上で液 滴を形成し、2) 液滴の中でも低温度の下地層側では徐々に

原子の秩序配列が形成され、3)液滴下層側の固体-液体界 面において、 稠密面配向の場合 A-B-A-B または A-B-C 原子積層のいずれかの安定位置でほぼ層状に凝固が進行し てゆくと考えられる.したがって、Coスパッタ薄膜の完全 hcp 原子積層化のためには,液滴中の固相表面における hcp 原子積層時の自由エネルギーを低下させることが重要とな り、下地層の構造がそれに大きな影響を及ぼすことが考え られる.しかしながら、これまで SFs を簡便迅速な方法で 定量評価する手法がなかったため、下地層の構造とその上 に作製される Co 薄膜の原子積層について系統的に検討し た報告は少ない. 我々は c 面配向 Ru 薄膜が SFs のほとん ど入らない六方晶原子積層構造をとる特徴をもち、かつ成 膜時のガス圧や膜厚を変化させることにより,その粒径や, 表面凹凸形状を変化させ得るという知見を別途得ている<sup>8)</sup>. そこで本研究では、種々の Ru 下地上に作製した室温成膜 Co 薄膜の SFs の導入度合いを調べ、Co スパッタ膜の完全 六方晶積層化による高 Ku 化を実現する下地層構造につい て検討したので報告する.

## 2. 実験方法

試料はガス圧 0.6 Pa の成膜雰囲気下で dc マグネトロン

スパッタ法により室温で作製した. 基板には厚さ 0.635 mm の 2.5 インチガラスディスクを用いた. 成膜後の Co 薄膜の酸化を防ぐ目的で, 膜表層には保護膜を 30 nm 設け た.保護膜の材料としては、後述の In-plane XRD の入射 深さを低減させにくい C を選択した. 尚, 基板はカソード から 25 mm の距離に静止対向して設置されているため, 成膜中にプラズマに覆われる膜の温度上昇が懸念される. そのため保護膜は、余熱による Co 薄膜の炭化を避ける目 的で、Coの製膜後、真空槽中で 30 分程度保持した後に作 製した. 試料の層構成は glass sub./ Ta (5 nm)/ Pt (6 nm)/ Ru (Ar ガス圧 0.6, 8.0Pa, 膜厚 5, 200 nm)/ Co (d<sub>Co</sub> nm)/ C (30 nm)とした. Co 薄膜の構造は走査型透過電子顕微鏡 (STEM)および Cu Ka線を用いた Out-of-plane および In-plane XRD により観測した. In-plane 方向での XRD 観測は、X線の入射角を0.4°としたため、Coの場合表層か ら深さ約20nmまでの結晶構造を反映する.hcp原子積層 構造における面直および面内方向の格子定数 cおよび aは, (00.2) および (11.0) の面間隔 do0.2, d11.0 を用いて

 $c = 2d_{00,2}, \quad a = 2d_{11,0}$ (1)により導出した. 原子積層構造の評価は, In-plane XRD における (10.0) および (11.0) 回折線の強度比をローレ ンツ因子および原子散乱因子で補正した、補正強度比 Corrected *I*<sub>10.0</sub>/*I*<sub>11.0</sub> により評価した. 補正強度比は原子層 -A-B-の後に C 層が積層される確率 Pfcc と対応関係がある 5-7). 尚, Ru 下地層の原子積層構造は In-plane XRD にて 評価したところ, 種々の成膜プロセスにおいて Pfcc が 1%未 満のほぼ完全な hcp 原子積層であった.磁気特性について は、飽和磁化(Ms)を振動試料型磁力計(VSM)にて、Ku をトルク磁力計にて測定される垂直トルク曲線の 2θ 成分 振幅の印加磁界に対する飽和外挿値 L20<sup>sat</sup>から,

 $K_{\rm u} = L_{2\theta}^{\rm sat} + E_{\rm demag}$ (2)により求めた. ここで, Edemag は面内および面直方向にお いて生じる反磁界による単位体積あたりの自己エネルギー の差であり,

 $E_{\text{demag}} = 1/2 (N_{\text{out}} - N_{\text{inp}}) M_{\text{s}^2}$ 

(3)

である. Nout および Ninp はそれぞれ cgs-gauss 単位系にお ける面直および面内方向の反磁界係数であり、平坦な薄膜 の場合には  $N_{out} = 4\pi$ ,  $N_{inp} = 0$  である.

### 3. 実験結果および考察

## 3.1 種々の Ru 下地層上に作製した Co 薄膜の 垂直磁気異方性

下地層の構造が Co 薄膜の積層欠陥に及ぼす影響を調べ るため、構造の極端に異なる下地層の例として、凹凸およ び粒径の大きな Ru (Rurough)と小さな Ru (Ruflat)とを選択 した. Ruflat および Rurough 下地層成膜条件はそれぞれ Ar ガス圧  $P_{Ar}^{Ru}$ = 0.6 Pa,  $d_{Ru}$ = 5 nm および  $P_{Ar}^{Ru}$ = 8.0 Pa, d<sub>Ru</sub>= 200 nm とした. Fig. 1 には, Ru<sup>rough</sup>, Ru<sup>flat</sup>上に成膜 した Co 薄膜の (a) 飽和磁化 Ms および (b) L20<sup>sat</sup>の膜厚依 存性を示す. (a), (b) 中の点線はそれぞれ Coの M のバル ク値 1429 emu/cm<sup>3 10)</sup>, および薄膜における Edemag =  $-2\pi (M_{\rm s}^{\rm bulk})^2$ ,ならびに薄膜がバルク値と同等の $K_{\rm u}^{\rm bulk}$ 5.97×10<sup>6</sup> erg/cm<sup>3</sup><sup>11</sup> を有する場合のトルク振幅  $K_{\rm u}^{\rm bulk} = 2\pi (M_{\rm s}^{\rm bulk})^2$ を表している. Co 薄膜の  $M_{\rm s}$ は、いずれ の下地においても dco に依らずバルク値とほぼ同程度の値 であった. 一方  $L_{2\theta}^{sat}$  は,  $d_{C_0} = 200 \text{ nm}$  から 1 nm への減 少において Ru<sup>rough</sup>上では $-11 \times 10^{6}$  dyne/cm<sup>2</sup> から 0.76× 10<sup>6</sup> dyne/cm<sup>2</sup>, Ru<sup>flat</sup>上では $-12 \times 10^{6}$  dyne/cm<sup>2</sup> から-0.77×10<sup>6</sup> dyne/cm<sup>2</sup>に減少した.この結果から、 $|L_{2\theta}^{sat}|$ は概し

て dco が低下するにしたがい減少することがわかる. 一般 に薄膜における垂直トルク曲線の|L20<sup>sat</sup>|は|Ku-2πMs<sup>2</sup>|で表 されるが、今回の実験結果によるといずれの下地を用いた 場合も極薄膜領域において、バルク値から見積もられる振 幅絶対値 $|K_{u}^{\text{bulk}}-2\pi(M_{s}^{\text{bulk}})^{2}|$ を下回っている.更に, Rurough と Ruflat 下地層の場合の結果を比較すると, 前者の  $|L_{20}^{sat}|$ はどの  $d_{Co}$ においても値が小さいことが見てとれる.

以降では、Ru<sup>rough</sup>下地上の Co 薄膜に注目し、反磁界係 数および Kuと dcoとの関係について、Co 薄膜の結晶構造 および形状に注目して実験および解析を行った.

# 3.2 Co 薄膜の原子積層構造と形状

# 3.2.1 原子積層構造

Fig. 2 は種々の dco における Co 薄膜の (a) out-of-plane および (b) in-plane XRD プロファイルであ る.参考のためプロファイルの下部および上部にはそれぞ れ Ru および Co の粉末回折プロファイルも示した. (a) 中 の dco = 4, 8, 12, 16 nm の試料については強度を 10 倍に拡 大したプロファイルも示している. Out-of-plane 方向では 44.5° 近辺に, in-plane 方向では 40° および 75° 近辺に回折 が観測されている.これらの回折は、hcp Co の粉末回折プ ロファイルと比較するとそれぞれ Co の (00.2) および (10.0) ならびに (11.0) からの回折線に対応していること がわかる. したがって, 成膜した Co 薄膜は c 面配向した 六方晶構造をとっていることがわかる. dcoの減少にともな い Co (00.2) 回折線は dco < 30 nm において低角側に推移 している. また Co (10.0) 回折線の強度が(11.0) 回折線と 比較して増加している (Fig.3 (b) 網掛け部). これらの結果 は、dcoの低下にともないCoの格子定数cの伸張およびSFs の形成度合いの減少が生じていることを示している.



Fig. 1 (a) Saturation magnetization  $M_{\rm s}$  and (b) 2 theta component of the saturation torque  $L_{20}^{sat}$  as functions of thickness of Co film  $d_{Co}$ . Solid circle and open square plots relate to Co films deposited on Ru underlayer of 8.0 Pa, 200 nm (Rurough), and 0.6 Pa, 5 nm (Ruflat), respectively. Dotted lines in (a) and (b) show  $M_{\rm s}$  for Co bulk, self-energy by demagnetizing field and  $L_{2\theta}^{sat}$  for the Co films with uniaxial magnetocrystalline anisotropy  $K_{\rm u}$  of Co bulk.



**Fig. 2** (a) Out–of–plane and (b) in–plane XRD profiles for the Co films deposited on  $Ru^{rough}$ . Upper and bottom profiles show powder diffraction patterns of hcp Co and Ru, respectively.

Fig. 3 には (a) 格子定数 *a*, *c*および (b) *cla*の *d*<sub>0</sub>。依存 性を示す. (b) 中の破線は,剛体球モデルにおける *da* =1.633 である. *a* は *d*<sub>0</sub>の減少に対しほぼ一定であるのに 対し, *c* は *d*<sub>0</sub>のが約 30 nm 以下へと減少すると,約 4.07 Å から 4.10 Å にまで大幅に増大することがわかる. この結果 は, *c*の増大は,バルク Ru の*c*が約 4.28 Å であることを 考慮すると, Co 薄膜の格子定数が Ru のそれへと漸近した ことを示唆しているが,六方稠密面配向膜における格子整 合の効果が*a*ではなく*c*に現れていることが特徴的である. これにともない,*cla*は*c*の変化に対応し,*d*<sub>0</sub><30 nmに おいて *d*<sub>0</sub>の減少にともない約 1.622 から 1.631 へ急激に 増大し剛体球モデルでの幾何学的理論値 1.633 に近づく傾 向を示している. よって Ru<sup>rough</sup>上の Co 薄膜では,結晶の対 称性が *d*<sub>0</sub>の減少にともない等方的となる方向へと変化してい ることがわかる.

Fig. 4 には Co の原子積層構造の指標として,補正強度 比 Corrected *I*<sub>0.0</sub>/*I*<sub>1.0</sub> の *d*<sub>Co</sub>依存性を示す. 副軸には補正 強度比に対応する *P*<sub>fec</sub>を示した. Co 薄膜の補正強度比は,



**Fig. 3** (a) Dependence of lattice constant *a* (left vertical axis), *c* (right vertical axis), and (b) lattice constant ratio c/a on  $d_{Co}$  for Co films deposited on Ru<sup>rough</sup>. Dashed line indicates c/a for solid spherical model.



**Fig. 4** Dependence of corrected  $I_{10.0}/I_{1.0}$  on  $d_{C_0}$  for Co films deposited on Ru<sup>rough</sup>. The right vertical axis indicates the probability of -A-B-C- atomic–layer stacking,  $P_{fcc}$ <sup>6)</sup>.

 $d_{co}$ が 200 から 8 nm へ低下するにしたがい約 0.06 から 0.18 にまで増大することがわかる.この補正強度比の増大 は  $P_{fce}$ の約 4 から 1%への減少に対応している<sup>60</sup>.すなわち 今回の試料では、室温にてスパッタ成膜した Ru<sup>rough</sup>上の Co 薄膜の原子積層構造が  $d_{co} = 8$  nm の極薄膜領域におい てほぼ完全な hep 積層をとっていることを示唆しており、 下地層の構造も上部に積層される Co 薄膜の SFs の排除に 影響を及ぼすことを明解に示している.

#### 3.2.2 薄膜形状

Ru<sup>rough</sup>上に作製された Co 薄膜の形態を観測した. Fig. 5 には  $d_{Co} = 4$  nm の Co 極薄膜を Ru<sup>rough</sup>上にスパッタ成膜 した試料の断面視野の STEM 像を示した. 上段から下段に 向けて, (a) 暗視野 STEM 像, (b) Ru の L 線のエネルギー 分光型 X 線分析 (EDX) 像, (c) Co の K 線の EDX 像であ り, View1 と View2 はそれぞれ異なる視野での観測結果で ある.

Ru の EDX 像から,作製された Ru 層先端部は,粒径約 22 nm,頂点-谷部の距離が最大約 17 nm の凹凸構造を有 していることがわかる.また,Coの EDX 像から,Ru<sup>rough</sup>



**Fig. 5** Cross sectional STEM images of (a) dark field and (b) Ru, and (c) Co EDX maps for a 4–nm Co film on Ru<sup>rough</sup>. View1 and 2 show different fields of views.



**Fig. 6** Schematics of cross sections of the (a) thick and (b) thin Co films deposited on Ru<sup>rough</sup>, and schematics of stacking structure around (c) surface and (d) boundary between Co and Ru layers. Small and large spheres indicate Co and Ru atoms, respectively.

上に作製された Co 極薄膜は下地層の表面をほぼ均質に被 覆しており, Ruの表面凹凸を反映した形状を有している ことがわかる.

## 3.2.3 傾斜結晶面を有する Ru 下地層上への Co 薄膜の 結晶成長様式

上記の形態および結晶構造の解析結果から, Co 薄膜の 成長様式を推察した. Fig. 6 には粗れた Ru 下地層上に成 膜された Co 薄膜について (a) 厚膜 ( $d_{Co} > 30$  nm) および (b) 極薄膜 ( $d_{Co} < 8$  nm) の断面構造の模式図, ならびに (c) Co 厚膜の表層および (d) Co-Ru 界面における原子積層 構造を示した. 大小の球はそれぞれ Ru および Co 原子を示 しており, 積層構造の左には稠密充填の積層位置 (A, B, C) を表記した.

飛来したスパッタ Co 原子は Co 厚膜の表層においては 凝固した Co結晶粒上にスパッタ Coが液滴をなし、凝固析 出する. その際 4%程度の割合で A-B-C 原子積層が膜中に 形成される (Fig. 6 (c)). 一方, 成膜初期の Ru と Co との 界面付近においては Ru 下地層の傾斜結晶面上にマイグ レーションしたスパッタ Co が液滴をなすと考えられる. 実験結果によるとA-B-C原子積層の形成度合いは1%以下 で、ほぼ完全なhcp原子積層が実現されていた (Fig. 6 (d)). 3.2.1 において、極薄膜領域において cのみが増大したこと を考慮すると、この Co-Ru 界面における積層欠陥の低下は、 Co 原子が Ru の傾斜結晶面上において面直方向の Ru の原 子配列をも反映して格子整合析出したために、膜法線方向 への-A-B-A-B-原子積層が実現したと考えられる (Fig. 6 (d), 破線). また, Co 薄膜の a が膜厚の変化に対して一定 であった要因としては、 Ru 表面が傾斜結晶面で構成され ていたため, Co が Ru の a を参照することができなかった ことが挙げられる.

## 3.3 Co 薄膜の垂直磁気異方性エネルギーの解析 3.3.1 反磁界による自己エネルギー

3.2.2 における断面構造の観察結果から、Co は  $d_{\rm Co} = 4$  nm 前後においては凹凸形態を有することが判明した. そのため、 $K_{\rm u}$ の導出には、 $L_{20}^{\rm sat}$ の Co 薄膜の形状を考慮した反磁界補正が必須である.前節までに結晶磁気異方性の所以となる結晶構造を議論した.本節では、 $L_{20}^{\rm sat}$ に及ぼす結晶磁気異方性エネルギーの項を極力排除して反磁界による自己エネルギーを評価し、反磁界係数を導出する.具体的



**Fig. 7** Dependence of  $L_{20}^{\text{sat}}$  on thickness of FeCoB film  $d_{\text{FeCoB}}$  for FeCoB amorphous films deposited on Ru<sup>rough</sup>. Dashed line shows self energy due to demagnetization field  $-2\pi M_{\text{s}}^2$ .

には、アモルファスの CoFeB 薄膜を粗れた Ru 下地層上に 成膜し、その垂直トルク曲線を測定した.

Fig. 7 には Ru<sup>rough</sup>上に作製したアモルファス FeCoB 薄膜における  $L_{20}$ <sup>sat</sup>の磁性層膜厚  $d_{FeCoB}$ 依存性を示す. 図中の破線は FeCoB 薄膜の  $M_s$  =1580 emu/cm<sup>3</sup>から導出した,磁性膜の形状が完全に平坦な場合の  $L_{20}$ <sup>sat</sup> =  $-2\pi M_s^2$  である. Ru<sup>rough</sup>上に作製された FeCoB 薄膜の  $L_{20}$ <sup>sat</sup>は,  $d_{FeCoB}$  = 200 nm の厚膜領域では $-2\pi M_s^2$ に対し約95%程度の値を有するが,  $d_{FeCoB}$ の低下にともない大きさが低下することがわかる.

Fig. 8には FeCoB 薄膜の  $L_{20}$ <sup>sat</sup>から導出した反磁界係数 差 ( $N_{out}-N_{inp}$ )の  $d_{FeCoB}$ 依存性( $\oplus$ ),および妥当性検証の ために数値計算により導出した反磁界係数差( $\Box$ )を示す. 数値計算では,膜中の平均的な反磁界を求め $4\pi M_s$ で規格 化することで反磁界係数を導出した.尚,1 結晶粒のモデ ルは断面 TEM 像を参考に作成した.反磁界計算の手順と



Fig. 8 Demagnetization factor as a function of  $d_{\rm FeCoB}$  for FeCoB amorphous films deposited on Ru<sup>rough</sup> ( $\bigcirc$ ) and calculated value ( $\Box$ ). Insets show schematics of cross sectional views for the amorphous FeCoB films on Ru<sup>rough</sup>.

**Table 1** Parameters for numerical analysis to derive the demagnetizing factor of ferromagnetic films deposited on a rough underlayer.

d <sub>ferro</sub> (nm)	Numbers of grains	Numbers of division/ grain	
		in-plane	Out-of-plane
4	32768	2048	32
16	32768	2048	64
50	8192	2048	64
100	8192	2048	128
200	8192	2048	128

しては、まず各々の強磁性結晶粒の表面(磁性層-下地層界 面および磁性層-真空界面)に磁極を設置した.次にその点 磁極が膜中に作る平均的な反磁界を、磁性膜を三角柱形状 のメッシュに区切り、各々の重心位置での磁界を平均化す ることで導出した. Table 1 には薄膜モデル中の結晶粒の数, および 1 結晶粒内の分割数を示す. 挿入図は厚膜および極 薄膜領域における FeCoB 薄膜断面構造の模式図である. FeCoB 薄膜の  $L_{20}$ <sup>sat</sup>から導出した結果を見ると、厚膜領域 での反磁界係数差は、平坦な薄膜における値 4 $\pi$ の約 95%程 度の値を有している. 一方  $d_{\rm FeCoB}$  が低減するにつれて反磁 界係数差は減少し、 $d_{\rm FeCoB}$  = 4 nm の極薄領域では約 20% 以下にまで低下することがわかる. この薄膜化による反磁 界係数差減少の傾向は数値解析の結果においても顕著に現 れている.

### 3.3.2 一軸結晶磁気異方性エネルギー

前節で導出した Edemag により Coの Ku導出を試みる.また, Kuと結晶構造との相関についても議論するため、Coの原子積 層構造および c la についても示す. Fig. 9 は Rurough 上に作製 した Co 薄膜の (a) Ku および (b) Pfcc ならびに (c) 格子定数比 c  $la の d_{Co}$ 依存性である.  $K_{u}$ は,  $L_{20}$ <sup>sat</sup>から各  $d_{Co}$ 毎の  $E_{demag} = 1/2$ (Nout-Ninp) Ms<sup>2</sup>を差し引いて導出した.(c) 中の破線は剛体球モ デルでの cla である. Kuは dco=200 nm から 30 nm への減少 につれて約2.0×10<sup>6</sup> erg/cm<sup>3</sup>から極大値5.0×10<sup>6</sup> erg/cm<sup>3</sup>まで 増大し、dco < 30 nm では急激に低下している. Kuが dco に対 し極大を示した結果に関して、結晶構造と照らしあわせながら 考察を行う. Pfacは 100 nm 近辺から 30 nm で 2%以下, 20 nm 以下で 1%以下となり、ほぼ完全 hcp 構造となる. 一方、 c/a は30 nm 以下では1.622 から 1.631 Åへと剛体球モデルの理 論値に近づき等方性を増す. この兼ね合いで dco = 30 nm にお いて極大を示したものと考えられる.以上の考察から、室温成 膜の Co スパッタ薄膜の Ku を高める方策として、下地層の傾斜 結晶面への格子整合析出を活用する方法が有効であることがわ かった. これは Co 薄膜に, 膜法線方向への下地層の六方原 子配列を反映した整合析出を促し SFs の形成を許さないこ とによる. さらなる Kuの向上のためには, 積層欠陥を排除 させた状態で claを 1.633 より大幅に低減させること, すなわ ち、Co薄膜が格子定数 cを下地と整合させた場合に c/a が低下 するような下地層の材料選定が有効であると考えられる.

### 4. まとめ

スパッタ Co 薄膜の原子積層構造におよぼす下地層の影響について、種々の粗さ、粒径を有する Ru 下地層を用いて検討した.その結果、凹凸の大きな Ru 下地層を用いた  $d_{Co} \leq 30 \text{ nm}$ の試料において、飽和トルク値の絶対値がバル ク値から導出した理論値  $|K_u^{Cobulk}-2\pi(M_s^{bulk})^2| = 6.8 \times 10^6$ erg/cm<sup>3</sup>を大きく下回る振幅を示すことが判明した.このト



**Fig. 9** Dependence of (a)  $K_{\rm u}$ , (b)  $P_{\rm fcc}$  and (c) lattice constant ratio c/a on  $d_{\rm Co}$  for Co films deposited on Ru<sup>rough</sup>. Dashed lines in (a) and (c) show  $K_{\rm u}$  for bulk Co and c/a for solid spherical model.

ルク振幅の変化要因について理解するために、まず原子積 層構造を X 線により解析した結果, fcc 原子積層の割合が 1%以下のほぼ完全な hcp 原子積層となっていることがわ かった. また  $d_{\rm Co} \leq 8$  nm の極薄膜領域において格子定数 cのみ 0.6%ほど増大していた. また, 試料の断面構造を観測 した結果,表面形態は下地層を反映して凹凸構造をとって いた. これらのことから、Co原子は粗れた Ru下地層の傾 斜面上において面直方向の Ru 原子積層構造を反映した結 晶成長を行ったため、 hcp 安定な積層構造をとったと考え られる. Co の凹凸構造を考慮した Edemag により L20<sup>sat</sup>を補 正して Kuを導出した結果, dco=200 nm から 30 nm への減 少につれて約2.0×10<sup>6</sup> erg/cm<sup>3</sup>から極大値5.0×10<sup>6</sup> erg/cm<sup>3</sup>ま で増大し、dco < 30 nm では急激に低下した. 上記結晶構造と 対応させて考えると、下地層の傾斜結晶面への Co の格子 整合析出が Ku 増大に有効であることが判明した. 30 nm 以下での Ku低下要因は, 極薄膜領域において Ru 下地層と の界面において Co 結晶粒の c が伸張し結晶対称性が等方 的となったためと考えられる.

謝辞 試料作製にあたり、ガラス基板を提供頂いたオハラ株式会社の後藤直雪氏ならびに山口勝彦氏に感謝致します.本研究は科学研究費補助金,特別研究員奨励費 22・7524の助成を受けて行われた.

### References

- 1) G. B. Mitra and N. C. Halder, Acta Cryst., 17, 817 (1964).
- 2) A. Ishikawa and R. Sinclair, *IEEE. Trans. Magn.*, **32**, 5 (1996).
- T. Shimatsu, H. Sato, Y. Okazaki, H. Aoi, H. Muraoka, Y. Nakamura, S. Okamoto, and O. Kitakami, *J. Appl. Phys.*, 99, 08G908 (2006).
- 4) P. Bruno, Phys. Rev. B, 39, 865 (1989).
- S. Hinata, R. Yanagisawa, S. Saito, and M. Takahashi, J. Appl. Phys., 105, 07B718 (2009).
- 6) S. Saito, A. Hashimoto, D. Hasegawa, and M. Takahashi, J. Phys.

- D: Appl. Phys., **42**, 145007 (2009). N. Nozawa, S. Saito, S. Hinata, and M. Takahashi, J. Appl. Phys., 7) 46, 172001 (2013). S. Saito, K. Inoue, and M. Takahashi, *IEEE Trans. Magn.*, 47, 3955
- 8) (2011).
- 9) S. Yonemura, S. Saito, A. Hashimoto, and M. Takahashi, *J. Magn. Magn. Mat.*, **320**, 3053 (2008).
- 10) A. J. P. Meyer and P. Taglang, C. R. Hebd. Seances Acad. Sci., 231, 612 (1950).
- R. Pauthenet, Y. Barnier, and G. Rimet, J. Phys. Soc. Jpn., 17, 309 (1962).

2013年6月30日受理, 2013年9月9日再受理, 2013年9月24日採録